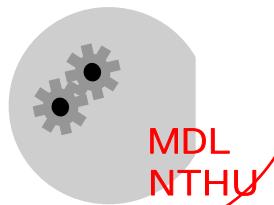


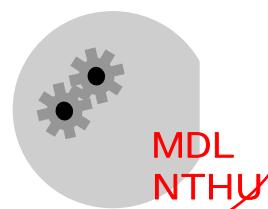
1.3 MEMS at Taiwan

- 國內從事 MEMS 研發的單位
 - + 工研院 - 電子所, 機械所, 材料所, 光電所, 化工所
 - + 同步輻射研究中心 - X-ray LIGA
 - + 精密儀器發展中心 - Excimer Laser LIGA
 - + 高速電腦中心 - Software
 - + 中研院
 - + 中科院
 - + 大學：清大, 台大, 交大, 成大, 中山, 中興, 中正, 淡江, 台科大, 雲科大, ...
- 國內 MEMS 研究經費的來源
 - + 國科會
 - + 經濟部 - 工研院、中科院
 - + 國家衛生院
- 微系統科技協會



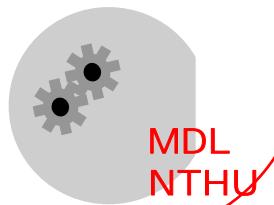
- 國內從事 MEMS 的業界

- + 台積電
- + 探微 (華新麗華)
- + 亞太優勢
- + 光磊
- + 駒通
- + 倍強
- + 全磊
- + 日月光
- + 明碁
- + 國際聯合
- + 美律
- + 台達
- + 矽晶源
- + 精鎮先進



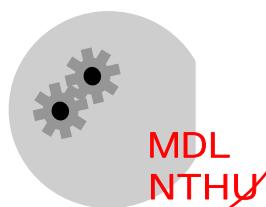
- 國內 MEMS 研討會
 - + 奈米工程暨微系統技術研討會，每年 11 月工研院電子所/機械所主辦
 - + 微系統科技協會年會，每年 3~4 月
 - + 中華民國機械工程師協會年會，每年 12 月
 - + 中華民國力學協會年會，每年 12 月
- 國內 MEMS 訓練課程
 - + 微機電系統基礎人才訓練課程，每年暑期國科會中區微機電系統研究中心主辦
 - + 微機電系統實作訓練課程，每年數梯次國科會中區微機電系統研究中心主辦
 - + 微機電系統基礎人才訓練課程，每年暑期國科會北區微機電系統研究中心主辦
 - + 精密儀器發展中心，不定期舉辦
 - + 高速電腦中心，不定期舉辦

** 其他尚有一些單位不定期舉辦訓練課程和研討會

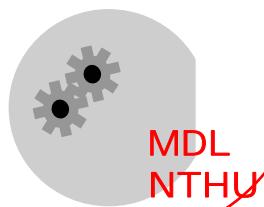


MEMS at Tsing Hua

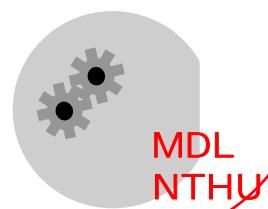
- 於 86 年成立 國科會中區微機電系統研究中心
- 於 87 年成立國內第一個大學部「微系統科技學程」
- 於 90 年成立國內第一所「微機電系統研究所」
- 於 90 年成立 奈米/微機電研究中心
- 台積電講座/國聯光電講座



- MEMS projects at PME (自 2000 年為止)
 - + 面型微機電系統製程技術開發計劃 - 工研院院部
 - + 生醫與微組裝用之微機械臂 - 工研院院部
 - + 微流體射入分析系統 (3年) - 國科會
 - + 微掃瞄器 - 國科會
 - + 微虛擬實鏡系統 (3年) - 國科會
 - + 微夾持器 - 國科會
 - + 微光碟機讀取頭定位系統 - 國科會
 - + 塑封球柵陣列電子封裝 (3年) - 國科會
 - + 超細纖維紡口 (3年) - 產學計劃
 - + 微系統雷射製程及檢測技術開發 - 精密儀器發展中心
 - + 微驅動系統技術研究 - 工研院機械所
 - + 微扭轉系統技術研究 - 工研院機械所
 - + 微加工精蟲分離器 - 榮清計劃
 - + 微燃燒器 - 中科院

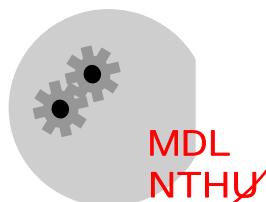


- 新竹地區可提供 MEMS 製造測試的單位
 - + 位於清大的自強基金會
 - + 清大 - 電機系, 動機系, 工科系, 材料系, 材料中心
 - + 國科會中區微機電系統研究中心
 - + 交大半導體中心
 - + 國家毫微米實驗室
 - + 國科會同步輻射研究中心 - X-ray
 - + 國科會精密儀器發展中心 - Excimer Laser
 - + 國科會高速電腦中心 - Software
 - + 國家晶片設計製造中心 - CMOS 標準製程
 - + 工研院電子所 - MEMS 製程實驗室
 - + 工研院機械所 - 非矽微加工製程實驗室
 - + 工研院材料所 - 矽微加工製程



MEMS at USA

- USA - MEMS 發展得很早, 早期政府並未特別重視, 多半由學校和各私人公司合作, 其中較著名的成果有:
 - + Analog devices - accelerometer
 - + NovaSensor - sensors
 - + Honeywell - IR image detector
 - + Texas Instruments - DMD (digital micromirror devices)
- 然而近年來透過國防部的尖端技術研究計畫局 (**DARPA** , **defense advanced research projects agency**), MEMS 的研發進行資助



Manufacturing Low-Cost MEMS Inertial Sensors, Charles Stark Draper Laboratory, Inc. & Boeing North America

SCREAM MEMS, Cornell University

Bimetallic Actuators for Micromachined Structures, EG & G IC Sensors

Reliability of Micromechanical Structures, Failure Analysis Associates, Inc.

Micromechanical Crossbar Photonic Switching Array, General Electric

MEMS-Based Smart Tires, Goodyear Tire and Rubber Company

New Organic Materials and Processes for MEMS, Harvard University

LIGA-Based Tunable Optical Filters for Multispectral IR Imagers and Gas Analyzers, Honeywell, Inc.

Polychromator: A MEMS-Based Optical Correlation Spectrometer System, Honeywell, Inc.

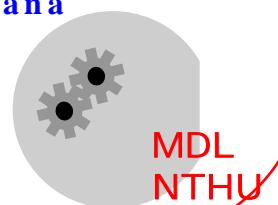
Compact, High-Capacity Data Storage Using Proximal Probes, IBM Almaden Research Center

Flexible Manufacturing of Dissolved-Wafer Silicon Capacitive Sensors (CAPS), Integrated Sensing Systems, Inc. (ISSYS)

Microfabricated DNA Analysis System, Lawrence Livermore National Laboratories

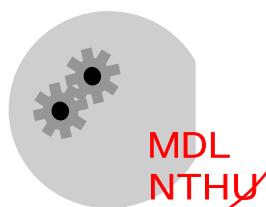
Applications and Mass Production of High Aspect Ratio Microstructures, Louisiana State University

Single Crystal Silicon Actuators and Sensors Based on Silicon Fusion Bonding Technology Lucas NovaSensor CAD for Microelectromechanical Systems (MEMCAD), Massachusetts Institute of Technology



MEMS at Japan

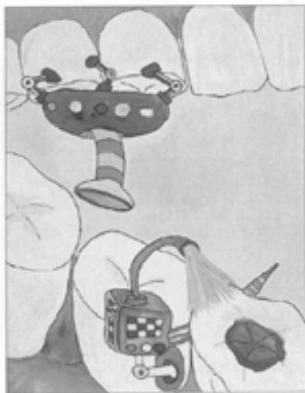
- Japan - 從 1991 年起由政府成立 MMC(Micromachine Center), 推動一個為期 10 年的國家型計畫, 主要的研究目標有三:
 - + 電廠維修技術 (advanced maintenance technologies for power plant)
 - + 微工廠技術 (micro-factory technologies)
 - + 微機械技術在醫療方面的應用 (micromachine technologies for medical applications)
- 從這些研究目標, 可帶動多項基本技術的建立, 例如微機械製造製程, 感測器, 致動器, 能源供應, 近距離通訊等技術
- 精密機械加工為其另一特色 - 微放電、微射出



+ Micromachine drawing contest (Japan) - primary school

Best Entry:

Corner cleaner tooth pick machine

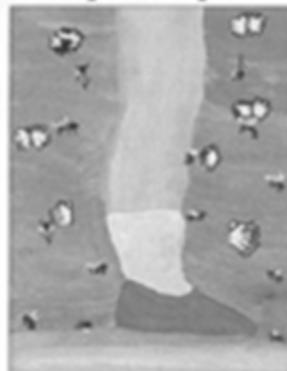


Saiko Sugiura

Fujimatsu-ninami Primary School (5th grade)

Honorable Mention:

Mr. Mosquito-repellent

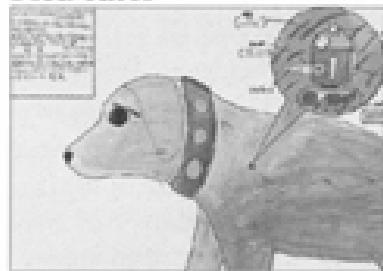


Maiko Ino

Kinbara Primary School (8th grade)

Third Prize:

Flea eater

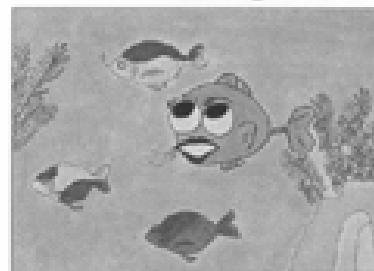


Mimoru Niwa

Futaba Primary School (6th grade)

Second Prize:

Water refresher goldfish



Ayako Nishida

Naniki Primary School (8th grade)

Figure source: MMC Micromachine, 1996

+ Micromachine drawing contest (Japan) - junior high school

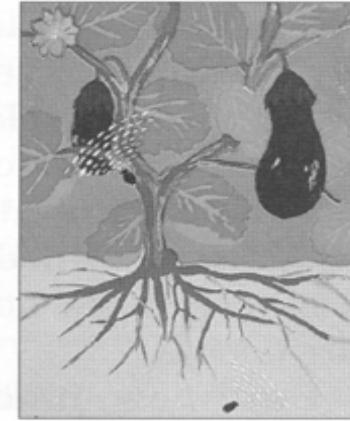
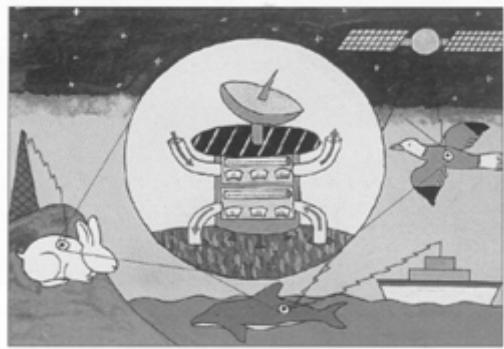
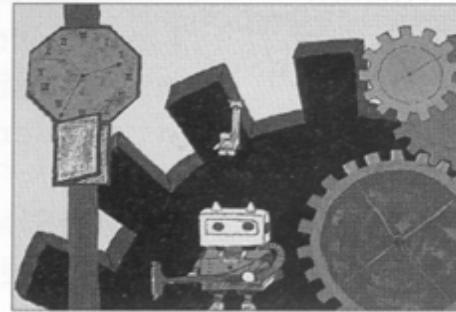
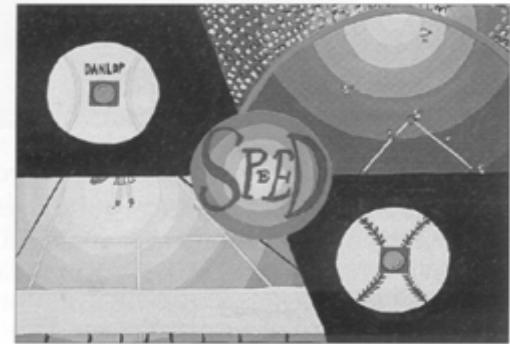
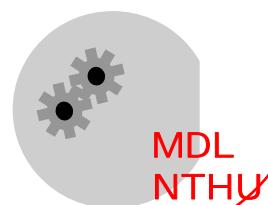


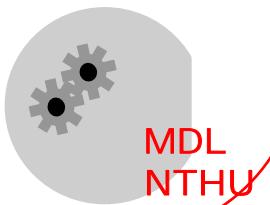
Figure source: MMC Micromachine, 1996

MEMS at Europe

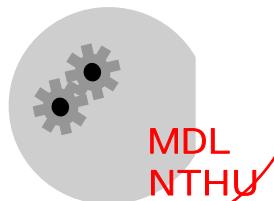
- European Commission (EC, 歐盟委員會) :
The EC places a high priority on developing strategies for growth competitiveness, and employment within the European Union (EU). It's long term goal is to promote further expansion of the EU.
- DG - There are 23 directorates-general (DGs) working in EC, for instance:
 - + DG1: external relations
 - + DG3: industrial practices
 - + DG23: consumer health protection
- ESPRIT program (European Strategic Program for R&D in Information Technology) in DG3 -
supporting the industrial R&D and technology transfer within information technologies
- BRITE-EURAM program (Basic Research in Industrial Technology for Europe - European Research on Advanced materials) in DG12

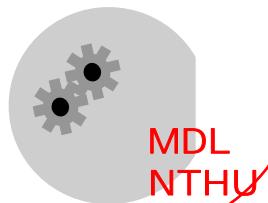
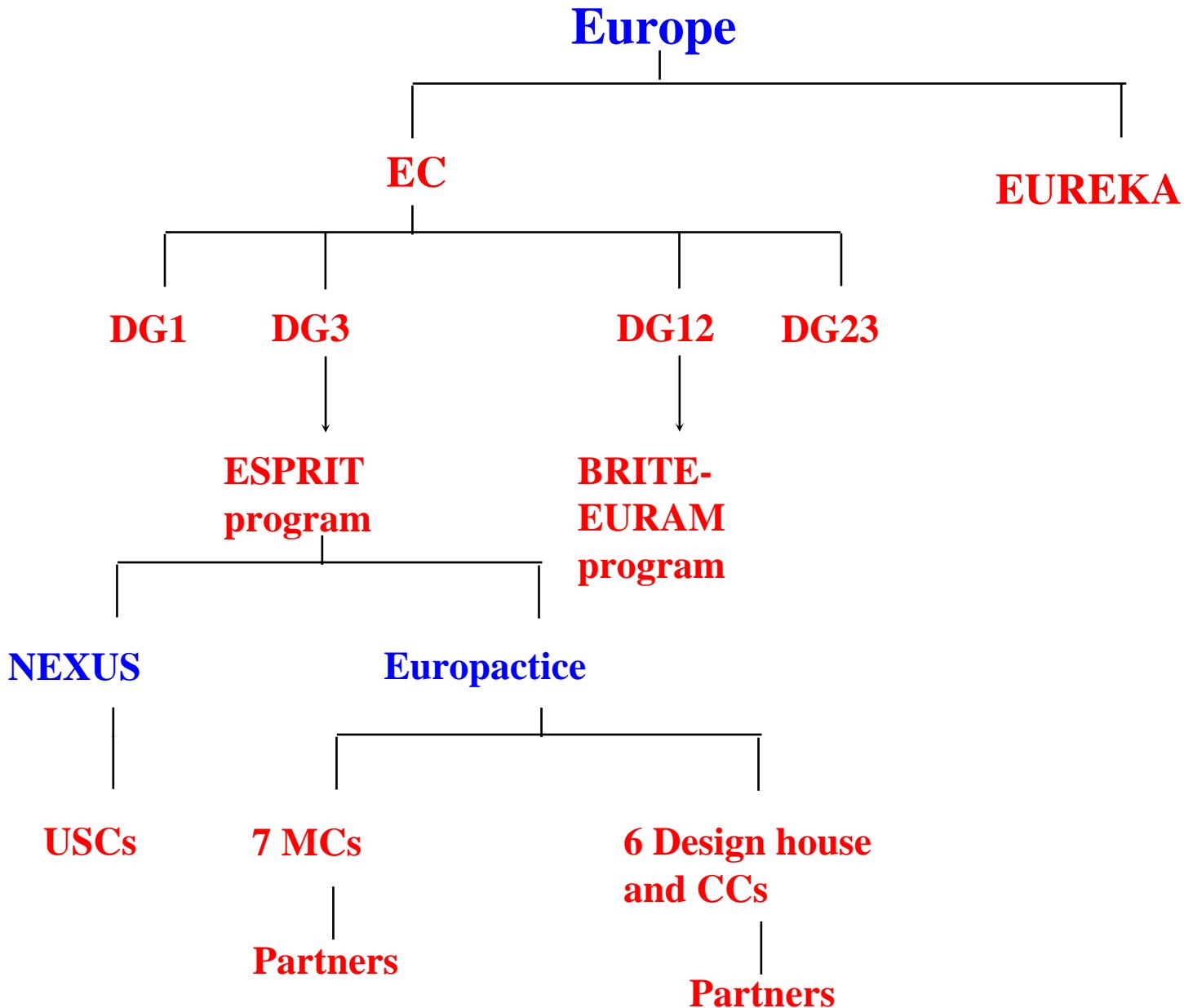


- **EUREKA** - is not a EC project, but an ‘Europe-wide network for industrial R&D’
 - + EUREKA projects are highly market-driven
- **EUROPRACTICE (ESPRIT)** -
Basic services offers a cost-effective and flexible means of accessing ASICs MCMs, and Microsystems technologies and training
 - + 7 Manufacturing Clusters (MCs)
 - + 6 Centers of Competence (CCs) and design house



- **NEXUS (ESPRIT) -**
Provides an industrial and academic forum to accelerate the distribution of MST information
 - + Stimulating cooperation
 - + Provide future direction
 - + Identifying technological requirements for microsystems
 - + Monitoring MST developments worldwide
 - + Promoting MST awareness - workshop, news, reports, web
 - + Integrating the East European MST
- **USCs - NEXUS brings together users and suppliers (technologies and components) of MST to promote the industrial uptake of MST. 5 USCs are established. 1 is under preparation**
 - + USC2: medical, biomedical, and pharmaceutical
 - + USC3: Instrumentation and process control
 - + USC4: Peripherals and multimedia
 - + USC5: Aerospace and geophysics
 - + USC6: Telecommunication (under preparation)
 - + USC7: Household appliances





- **Germany** - 從 1990 年開始, 進行十年計畫, 分兩階段執行. 其中第一階段為 1990 ~ 1993 經費共四億馬克, 第二階段為 1994 ~ 1999 每年經費一億馬克
- **France** - 國家型計畫, 執行期間 1993 ~ 2000
- **Switzerland** - 國家型計畫, 執行期間 1996 ~ 1999
- 歐洲還有許多國家也大力推動 MEMS 技術, 例如荷蘭, 瑞典, 等國家

